

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 9 月 13 日 (2007.9.13)

【公表番号】特表 2007-506970 (P2007-506970A)
 【公表日】平成 19 年 3 月 22 日 (2007.3.22)
 【年通号数】公開・登録公報 2007-011
 【出願番号】特願 2006-527975 (P2006-527975)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 13/00 (2006.01)

G 0 1 N 33/50 (2006.01)

G 0 1 N 33/15 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 13/00

G 0 1 N 33/50 Z

G 0 1 N 33/15 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 7 月 25 日 (2007.7.25)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

第 1 および第 2 の対向する表面と、前記第 1 の表面から外側に延在している複数の中空突出部であって、開口部のあるテーパ先端部と、前記突出部内に配置された前記開口部と連続した各キャビティとを有する中空突出部とを有する第 1 のベースと、

第 1 および第 2 の対向する表面を有し、前記第 1 の表面が、前記複数の中空突出部と係合するよう構成され、第 2 のベース中へ延在している各キャビティと連続した、複数の窪みテーパ開口部を有する、第 2 のベースと、

中空突出部が通過できるよう構成された穿孔部を有する保持プレートであって、前記保持プレートが第 2 のファスニング手段により前記第 2 のベースに留められており、前記膜が前記第 2 のベースと前記保持プレートの間に配置されている、保持プレートと、

前記窪みテーパ開口部と前記中空突出部の前記先端部に接触する膜と、
 を含み、前記第 1 のベースが第 1 のファスニング手段により前記第 2 のベースに留められており、a) 中空突出部内の各キャビティは前記第 1 のベースを通して延在して、前記第 1 のベースの前記第 2 の表面に開口部を形成し、または b) 前記第 2 のベース内の各キャビティは前記第 2 のベースを通して延在して、前記第 2 のベースの前記第 2 の表面に開口部を形成し、または c) 中空突出部内の各キャビティは前記第 1 のベースを通して延在して、前記第 1 のベースの前記第 2 の表面に開口部を形成し、前記第 2 のベース内の各キャビティは前記第 2 のベースを通して延在して、前記第 2 のベースの前記第 2 の表面に開口部を形成する、膜を通して化合物の拡散を測定するシステム。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のシステムを提供する工程と、

前記第 1 のベースの少なくとも 1 つのキャビティ中に第 1 の流体組成物を配置する工程と、

前記第 2 のベースの少なくとも 1 つのキャビティ中に化合物を含む第 2 の流体組成物を配置する工程と、

前記第 1 の流体組成物の前記化合物含量を分析する工程と、
を含み、前記第 1 および第 2 のベースの前記キャビティが膜を介して流体連通している、
膜を通した化合物の拡散を測定する方法。

【請求項 3】

第 1 および第 2 の対向する表面と、前記第 1 の表面から外側に延在している複数の中空
突出部であって、開口部のあるテーパ先端部と、前記突出部内に配置された前記開口部と
連続した各キャビティとを有する中空突出部とを有する第 1 のベースと、

第 1 および第 2 の対向する表面を有し、前記第 1 の表面が、前記複数の中空突出部と係
合するよう構成され、第 2 のベース中へ延在している各キャビティと連続した、複数の窪
みテーパ開口部を有する、第 2 のベースと、

中空突出部が通過できるよう構成された穿孔部を有する保持プレートと、

前記第 2 のベースに前記保持プレートを留める手段と、

前記第 1 のベースを前記第 2 のベースに留める手段と、

を含み、a) 中空突出部内の各キャビティは前記第 1 のベースを通して延在して、前記第
1 のベースの前記第 2 の表面に開口部を形成し、または b) 前記第 2 のベース内の各キャ
ビティは前記第 2 のベースを通して延在して、前記第 2 のベースの前記第 2 の表面に開口
部を形成し、または c) 中空突出部内の各キャビティは前記第 1 のベースを通して延在し
て、前記第 1 のベースの前記第 2 の表面に開口部を形成し、前記第 2 のベース内の各キャ
ビティは前記第 2 のベースを通して延在して、前記第 2 のベースの前記第 2 の表面に開口
部を形成する、膜を保持する、キットの形態にあるシステム。